

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 1 区分
 【発行日】令和 3 年 12 月 16 日 (2021.12.16)

【公開番号】特開 2021-162348 (P2021-162348A)
 【公開日】令和 3 年 10 月 11 日 (2021.10.11)
 【年通号数】公開・登録公報 2021-049
 【出願番号】特願 2020-61297 (P2020-61297)
 【国際特許分類】

G 0 1 B 11/30 (2006.01)

G 0 1 N 21/892 (2006.01)

G 0 1 N 21/88 (2006.01)

【 F I 】

G 0 1 B 11/30 A

G 0 1 N 21/892 Z

G 0 1 N 21/88 Z

【手続補正書】

【提出日】令和 3 年 11 月 4 日 (2021.11.4)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 7 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 7 4 】

判定工程は、検査装置 (5 0 0) を用いて例えば以下のように実施することができる。

まず、検査装置 (5 0 0) の制御装置 (5 7 0) は、撮影工程を実施する各種条件に基づき前方被写界深度及び後方被写界深度を計算する。各種条件と被写界深度の関係について予め計算しておき、計算結果を制御装置 (5 7 0) の記憶部に登録しておいてもよい。

次いで、制御装置 (5 7 0) は、円柱状ハニカム構造体 (5 5 0) の側面 (5 5 3) からの反射光をラインセンサカメラ (5 3 0) で繰り返し撮影する工程を実施中、変位計 (5 8 5) を用いて計測された側面 (5 5 3) のピント面に対する前方への変位及び後方への変位を、当該変位が計測された側面 (5 5 3) の地点と関連付けて、それぞれ記憶する。変位が計測された側面 (5 5 3) の地点は、エンコーダを用いることにより検出可能である。但し、変位が計測された側面 (5 5 3) の地点を特定せず、変位だけ記憶してもよい。

次いで、制御装置 (5 7 0) は、前方被写界深度と側面 (5 5 3) のピント面に対する前方への変位とを対比することにより判定を実施し、前方への変位が前方被写界深度を超えた状態で撮影された前記側面 (5 5 3) の部分を特定する。制御装置 (5 7 0) は同様に、後方被写界深度と側面 (5 5 3) のピント面に対する後方への変位を対比することにより判定を実施し、後方への変位が後方被写界深度を超えた状態で撮影された前記側面 (5 5 3) の部分を特定する。但し、被写界深度を超えた前記側面 (5 5 3) の部分の特定は必ずしも行わなくてよい。